

施設数	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			年間			
	設定監視 計画件数 (a)	監視実 施件数 (b)	監視実 施率(%) (b/a)	設定監視 計画件数 (c)	監視実 施件数 (d)	監視実 施率(%) (d/c)	設定監視 計画件数 (e)	監視実 施件数 (f)	監視実 施率(%) (f/e)	設定監視 計画件数 (g)	監視実 施件数 (h)	監視実 施率(%) (h/g)	設定監視 計画件数 (i)=(a+c+e+g)	監視実 施件数 (j)=(b+d+f+h)	監視実 施率(%) (j/i)	
かき処理場	55	0	7	-	10	23	230%	12	73	608%	12	17	142%	34	120	353%
かき入礼場	2	0	0	-	0	0	0%	3	1	33%	2	1	50%	5	2	40%
かき袋詰め加工	63	0	9	-	26	32	123%	41	71	173%	28	34	121%	95	146	154%
合計	120	0	16	-	36	55	153%	56	145	259%	42	52	124%	134	268	200%

